

Inhalt

		Seite
<i>R. Feiertag</i>	Technischer Wandel durch Mikrotechnik	1
<i>A. Roosen und F. Aldinger</i>	Keramik als Substrat- und Gehäusewerkstoff	15
<i>K. Lubitz</i>	Mikrostrukturierung von Piezokeramik	35
<i>H. Schmidt</i>	Sol-Gen-Techniken für neue Materialien der Mikrotechnik	51
<i>R. Th. Kersten</i>	Plasma-Impuls CVD für SiO ₂ -Schichten	71
<i>K. Großkopf</i>	Glasanwendung für integrierte Optik	83
<i>D. Huber</i>	Halbleiter – Grundlagen	107
<i>A. Heuberger</i>	Mikromechanik – Sensorik	113
<i>E.-M. Kimmeler</i>	Mikromechanische Einflußgrößen auf die Zuverlässigkeit mikroelektronischer Bauelemente	253
<i>H. F. Schlaak</i>	Silicium als Werkstoff der Mikrooptik	265
<i>D. Stöckel</i>	Nickel-Titan – Formgedächtnislegierungen Eigenschaften und industrielle Anwendungen	287
<i>H. E. Hintermann</i>	CVD/PVD-Hartstoffschichten	303
<i>J. Wilde</i>	Neue Entwicklungen beim Löten	319
<i>D. Haarer</i>	Polymere Materialien für die Mikrotechnik	339
<i>P. Gleisberg</i>	LC-Polymere in der Mikrotechnik	357
<i>J. Bednarz</i>	3D-Leiterplattenwerkstoffe	371
	Referenten und Diskussionsleiter	385